

ご案内

InterOpto2018 出展募集

『InterOpto』は、光の構成要素からシステムまでのすべてを網羅し、研究用途から産業応用に至る光デバイス・レーザー関連製品が一堂に会する技術総合展です。

最新光技術の応用先は、精密機器や半導体、通信、計測からバイオテクノロジーに至るまで多岐に渡っており、その中でも特に注目度の高いアプリケーションに特化した専門展示会として、LED 応用の最先端技術・製品をテーマにした LED の設計製造展「LED JAPAN」、撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関する技術と製品をテーマにした最先端のイメージング技術が集結する展示会である「Imaging Japan」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光学技術+製品開発のパートナーイベント『All about Photonics』として最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

- 会 期： 2018年10月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00
会 場： 幕張メッセ国際展示場・国際会議場
来場予定数： 50,000名（同時開催展含む）
入 場 料： 1,000円（税込） ※事前登録者および招待状持参者は無料
同 時 開 催： 「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2018」
「CEATEC JAPAN 2018」
出 展 料： 通常小間 9m² 360,000円（税別）
パッケージ付 4m² 企業：180,000円（税別）
学校・公的機関・独法各研究室：50,000円（税別）

出展対象分野

レーザー/光源	半導体、ファイバ、YAG、赤外、UV-LED、可視光LED、超短パルス、テラヘルツ、各種レーザー発振器 等
オプティクス関連部品	レンズ/フィルタ、ミラー/プリズム、光学薄膜、光ファイバ、MEMS 光スキャナー、ガラス 等
測定装置/光分析機器	光測定器、光応用計測器、光伝送機器・装置、分光/分析機器・装置、分光光度計、近赤外分光計、OCT システム 等
レーザー加工システム	レーザー加工装置、微細加工装置、切断加工装置、マーキング装置、レーザー穴明装置、試作・受託加工、ガルバノスキャナ 等
情報通信	光ファイバ、5G、可視光通信 等

出展受付期間

出展申込締切：2018年6月29日（金）

※但し、締切日前でも規定の小間数になり次第受付終了とさせていただきますので、お早めにお申込みください。

申込方法につきましては下記ホームページを参照下さい。

<http://www.optojapan.jp/interopto/>